和周波分光イメージングによる DPh-BTBT 薄膜トランジスタの電界挙動

Probing the electric-field behavior in DPh-BTBT OFETs by Sum-Frequency Generation imaging spectroscopy

¹ 産総研,²Univ. of Houston 片桐 千帆¹,⁰宮前 孝行¹, Hao Li², Fangyuan Yang², Steven Baldelli² ¹AIST, ²Univ. of Houston Chiho Katagiri¹, ^oTakayuki Miyamae¹, H. Li², F. Yang², S. Baldelli² E-mail: chiho.katagiri@aist.go.jp

駆動中の有機電界効果トランジスタ (OFET) における有機薄膜の分子挙動並びに内部電界の分 布を明らかにするため、我々は Baldelli らによって開発された圧縮センシング (CS) を活用した SFG イメージング技術 [1] を使い、駆動中の OFET 内部での電界分布や蓄積電荷が引き起こす分 極現象に起因した電界誘起 SFG イメージング観察を試みた。用いた OFET は、酸化アルミニウム とオクタデシルホスホン酸 (ODPA) SAM を絶縁層に用い、DPh-BTBT を半導体層とした素子を観 測し、電圧印加によって生じる SFG スペクトルの変化と電界分布や電荷挙動測定を行った。

本実験で用いたボトムゲート/トップコンタクト型 OFET の素子構造を Fig.1 に示す。

Fig. 2 に open circuit およびゲート電圧印加時の CH 伸縮領域での SFG イメージング結果を示す。光の偏 光条件は SSP (SFG; S 偏光, 可視; S 偏光 IR; P 偏光) である。Fig. 2(a)は ODPA 由来の CH3 のフェルミ共鳴 (2940 cm⁻¹)におけるチャネル付近のイメージであり、 Fig. 2(b)はゲート電極に-3 V 印加した状態での SFG イメージである。ゲート電圧印加によってソース・ド レイン電極の縁で、フェルミ共鳴由来の SFG 信号の 増加が確認された。これはゲート電圧印加時に金電極 の縁付近に強い電界が生じており、これが絶縁層に達 していることを示唆している。本発表では、電圧印加 時のチャネル内の SFG スペクトル挙動に加え、開回 路状態とゲート電圧印加状態、ソース-ドレイン間に 電圧印加した際の絶縁層/有機半導体界面で生じる電 界の関係について議論する予定である。この成果は、 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機 構 (NEDO) の委託業務 (JPNP16010) の結果得られ たものである。

[1] D. Zheng, L. Lu, K. F. Kelly and S. Baldelli, *J. Phys. Chem. B*, **122**, 464-471 (2018)



Fig. 1. OFET device structure



Fig. 2. Methyl CH stretch SFG imaging for (a) open circuit condition and (b) $V_{gs} =$ -3 V. The intensity distribution across the semiconductor channel region for (c) open circuit and (d) $V_{gs} = -3$ V.